

平成 24 年度装置開発技術系活動報告

千田進幸

工学系技術支援室 装置開発技術系

1. はじめに

装置開発技術系は昨年度末に 1 名が退職し、4 月 1 日付で 1 名が新規採用された。また、シンクロトロン光研究センター配属の 3 名が全学の教育・研究技術支援室計測・制御技術室へ配置換えとなった。従って当技術系の本年度の人員構成は、課長 1 名、課長補佐 1 名、第 1 技術班 5 名（班長 1 名、班員 4 名）、第 2 技術班 4 名（班長 1 名、班員 3 名）、第 3 技術班 4 名（班長 1 名、班員 3 名）、第 4 技術班 5 名（班長 1 名、班員 4 名）であり、総勢 20 名である。

2. 装置開発技術系の実施業務

装置開発技術系は、短期・長期業務依頼による研究者・学生の独創的なアイデアに基づき、教育・研究に必要な機械装置の設計・試作、電子回路装置の製作、およびガラス製装置の製作を行っている。また、創造工学センターものづくり公開講座等の教育支援（本技報参照）、各学科・専攻の安全教育や工作実習支援業務、および平成 22 年度より始められた半導体プロセス技術等を支援する業務等を実施している。

3. 系の運営に関わる業務

3. 1 系業務調整会議

系の運営について協議する会議であり、課長、課長補佐、班長の 6 名で構成されている。本年度は原則的に毎週火曜日、始業時より 1 時間程度開催している。主な議題は技術部調整連絡会議の報告、班会議の報告、および技術系内の検討事項について協議している。尚、毎回の議事録は班長が輪番で書記を務め、次週の会議の冒頭で読み合わせを行い、内容の承認を取っている。

3. 2 系専門委員会

系内の業務の執行状況や運営に関わる諸問題などを協議する委員会であり、教員 4 名、技術職員 6 名（班長以上）で構成されている。本年度の会議の概要は次のようであった。

第 1 回

日時：平成 24 年 7 月 12 日（木）11:00～12:00

場所：ES 総合館小会議室（ES 館 3 階）

- 議題：(1) 系専門委員会の構成について
(2) 系経費の決算・予算について
(3) 活動計画について
(4) 技術部支援経費の使途について
(5) その他

4. 系に関わる研修等

4. 1 研修

本年度の装置開発技術系に関わった技術系研修は次のようであった。

(1) 課題：展示用加工サンプルの製作 (CAD/CAM マシニングセンタ)

研修者：後藤伸太郎、山本浩治、中木村雅史、齋藤清範

(2) 課題：新人育成研修としてのガラス加工旋盤用バーナー昇降機構の設計及び加工

研修者：磯谷俊史、白木尚康、中西幸弘、森木義隆、川崎竜馬

尚、内容の詳細は本技報に掲載されている。参照して頂きたい。

4. 2 講習会

本年度は10月1日(月)に次のような概要で講習会を開催した。

・テーマ：フォトリソグラフィの基礎講習

・講師：齋藤清範

尚、本講習会の詳細は、本技報に掲載されている。参照して頂きたい。

5. 出張報告会

技術系の業務として出張した場合には、得られた知識や情報を系メンバーが共有する目的として出張報告会を開催している。今年度は以下のように6件を開催した。

(1) 報告内容：鳥取大学技術部の行っている出張ものづくり講座に関する調査

報告者：後藤伸太郎

開催日時：平成24年9月7日(金) 9:30~10:00

(2) 報告内容：平成24年度ガラス加工技術ミニシンポジウムへ参加して

報告者：森木義隆、川崎竜馬

開催日時：平成24年10月12日(金) 10:30~11:00

(3) 報告内容：平成24年度能力開発セミナー フライス盤実践技術コースを受講して

報告者：磯谷俊史

開催日時：平成24年11月9日(金) 11:30~12:00

(4) 報告内容：平成25年度能力開発セミナー説明会に参加して

報告者：小塚基樹、澤木弘二、磯谷俊史

開催日時：平成24年11月9日(金) 11:30~12:00

(5) 報告内容：(株)不二越企業見学および富山大学工学部技術部見学・技術交流

報告者：小塚基樹、山本浩治、後藤伸太郎、磯谷俊史

開催日時：平成25年1月11日(金) 9:30~10:00

(6) 報告内容：東京工業大学半導体MEMSプロセス技術センター見学・技術交流及び nano tech2013

報告者：齋藤清範

開催日時：平成25年2月8日(金) 10:30~11:00